

株式会社 **SCREEN** セミコンダクターソリューションズ

## パターン付きウエハー外観検査装置を発売

～高解像度と高生産性を両立、次世代パワーデバイスの安定生産に貢献～

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズはこのほど、次世代パワーデバイスやCIS<sup>※1</sup>、MEMSなどのパターン検査に対応するウエハー外観検査装置「ZI-3600」を開発。11月から販売を開始します。



### ZI-3600

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、下記URLよりダウンロードできます。

[www.screen.co.jp/about/nr-photo\\_2022](http://www.screen.co.jp/about/nr-photo_2022)

近年、温室効果ガスの排出量を“実質ゼロ”にする「カーボンニュートラル」の実現に向けて、電気自動車や省エネ家電をはじめとするエネルギー効率に優れた製品の開発が加速。電力を効率的に制御するトランジスタやSiC<sup>※2</sup>、GaN<sup>※3</sup>などを使った次世代パワーデバイスへの需要が高まっています。また、Si（シリコン）においては、拡大する需要に応えるため、生産効率が高い300mm化が進められています。そのため、同デバイス用の製造装置には、省スペース設計に加え、生産デバイスのサイズ・種類・生産量への多様な適応力が求められています。

このような動向を背景に当社は、高生産性と高解像度を両立したパターン付き外観検査装置「ZI-3600」を開発しました。この装置は、100mm～300mmの幅広いサイズのウエハー外観検査に対応。独自開発の検査ヘッドと改良した高速画像処理エンジンにより、従来比約2倍<sup>※4</sup>の実用処理能力を実現しています。加えて、解像度の異なる3種類の対物レンズを1つのヘッドに搭載することにより、レンズを最適な解像度に自動で切り替えながら検査を行うため、微細欠陥からマクロ欠陥までの幅広い検査を一台で対応できます。また、従来機種と同様にラインセンサーによる全面検査方式を採用しており、チップサイズや数量に依存することなく一定のスピードで検査が可能。製品の歩留まり向上および安定生産に大きく貢献します。

当社は、今回の「ZI-3600」の開発により、「ZIシリーズ」の高生産性と高解像度を実現し、次世代パワーデバイスやCIS、MEMSなどの安定生産に寄与します。今後もカーボンニュートラルの実現に向けた先端デバイスの省エネルギー化、高度化を実現するための研究開発を続け、半導体業界のさらなる発展に貢献していきます。

※1 CMOSイメージセンサー：CMOSセンサー技術を使用した低消費電力のイメージセンサー

※2 シリコンカーバイド：シリコン（Si）と炭素（C）で構成される化合物半導体材料

※3 窒化ガリウム：ガリウム（Ga）と窒素（N）で構成される化合物半導体材料

※4 「ZI-3500」との比較。パターン付き300mmウエハーを全面検査した場合

\* この新装置は、11月15日（火）から18日（金）まで開催される「SEMICON EUROPA 2022」のSCREENブースでご紹介します。 [www.semicon.europa.org/](http://www.semicon.europa.org/)

#### ● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ マーケティング部 Tel: 075-417-2527 [screenspe-info@screen.co.jp](mailto:screenspe-info@screen.co.jp)